

株式会社リガク製 X線回折装置 SLX2000

製造元	株式会社リガク
仕様	X線回折装置 . 60 kV, 300 mA . 2 分解能=0.0002 度 , 分解能=0.0001 度
保有部署	電子工学専攻 川上研究室
設置場所	桂・A1棟・B1階005室)
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210311-denshi
注意事項等	利用講習を受講のうえ、利用者自身で測定
連絡先	電子工学専攻川上研究室 075-383-2309 http://www.optomater.kuee.kyoto-u.ac.jp/
キーワード	結晶構造評価, 面間隔評価, 配向性評価
機器コード	(KUMaCo 稼働開始後、付与します)
自由記入欄	通常の 2 / あるいは スキャンに加え、逆格子マッピング, 極点測定, 反射測定が可能 . 2 および の分解能が高いため、精密測定に向けた装置 .

